

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載  
【部門区分】第 2 部門第 1 区分  
【発行日】平成 17 年 9 月 22 日 (2005.9.22)

【公開番号】特開 2003-305337 (P2003-305337A)  
【公開日】平成 15 年 10 月 28 日 (2003.10.28)  
【出願番号】特願 2002-109866 (P2002-109866)  
【国際特許分類第 7 版】

B 0 1 D 53/86

【 F I 】

B 0 1 D 53/36 B

【手続補正書】  
【提出日】平成 17 年 4 月 12 日 (2005.4.12)  
【手続補正 1】  
【補正対象書類名】明細書  
【補正対象項目名】特許請求の範囲  
【補正方法】変更  
【補正の内容】  
【特許請求の範囲】  
【請求項 1】

内部に内筒を設けて供給される P F C ガス、空気及び水の混合ガスの旋回流を発生させ、この混合ガスを加熱する予熱器と、前記予熱器で加熱された前記混合ガスに含まれる前記 P F C を分解する触媒が充填された反応器とを備えたことを特徴とする P F C ガス処理装置。

【請求項 2】

前記予熱器で加熱された P F C ガスを整流して前記反応器に導く多孔板を備えた請求項 1 記載の P F C ガス処理装置。

【請求項 3】

内部に内筒を設けて供給される P F C ガス、空気及び水の混合ガスの旋回流を発生させ、この混合ガスを加熱する第 1 予熱器と、前記第 1 予熱器で加熱された前記混合ガスが供給され、内部に内筒を設けて混合ガスの旋回流を発生させ、この混合ガスを加熱する第 2 予熱器と、前記第 2 予熱器で加熱された前記混合ガスに含まれる前記 P F C を分解する触媒が充填された反応器とを備えたことを特徴とする P F C ガス処理装置。

【請求項 4】

前記第 2 予熱器で加熱された P F C ガスを整流して前記反応器に導く多孔板を備えた請求 4 記載の P F C ガス処理装置。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書  
【補正対象項目名】0 0 0 4  
【補正方法】変更  
【補正の内容】  
【 0 0 0 4 】

本発明の目的は、予熱器を小型化することによりコンパクトな P F C 処理装置を提供することにある。

【手続補正 3】

【補正対象書類名】明細書  
【補正対象項目名】0 0 0 5  
【補正方法】変更  
【補正の内容】

## 【 0 0 0 5 】

## 【課題を解決するための手段】

上記した目的を達成する本発明の特徴は、内部に内筒を設けて供給される P F C ガス、空気及び水の混合ガスの旋回流を発生させ、この混合ガスを加熱する予熱器と、予熱器で加熱された混合ガスに含まれる P F C を分解する触媒が充填された反応器とを備えたことにある。

予熱器内に設けられた内筒が加熱面からの熱輻射によって高温となり混合ガスの加熱を促進するため、実効的な伝熱面積が増加することになり、予熱器を小型化できる。このため、コンパクトな P F C ガス処理装置を得ることができる。

## 【 手 続 補 正 4 】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 1 0

【補正方法】変更

【補正の内容】

## 【 0 0 1 0 】

## 【発明の効果】

本発明によれば、触媒を用いた加水分解による P F C ガス処理装置において、予熱器の実効伝熱面積が予熱器内に内筒を設けない場合の最大約 1.5 倍となり、P F C ガス処理装置を小型化することができる。特に、装置を大型化する場合ほどスペース低減の効果は大きい。